

Sphärischer EUV-Spiegel, 13,5 nm, 25,4 mm Durchmesser, 5 ° AOI



TECHSPEC® Extreme Ultraviolet (EUV) Spherical Mirrors

Produkt #11-730 **20+ In Stock**

- 1 + €4.310⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.310,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 +0.00/-0.13 **Durchmesser (mm):**

6.35 ±0.25 **Dicke (mm):**

Oberflächenrauheit (Angström):

Optische Eigenschaften

Art der Beschichtung:
Metal/Semiconductor

Beschichtung:
Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 632.8nm

Designwellenlänge DWL (nm):
13.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Einfallswinkel (°):
5

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} >60% @ 13.5nm

Radius R₁ (mm):
500.00

Krümmungsradius (mm):
500.00

Halbwertsbreite FWHM (nm):
0.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Mehrschichtige Mo/Si-Beschichtung auf hochglanzpolierten Substraten
- Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
- Entwickelt für EUV-Strahlfokussierungsanwendungen
- Schmalere Durchlassbereich für HHG-Anwendungen

TECHSPEC® Sphärische Spiegel für extremes Ultraviolett (EUV) verfügen über eine mehrschichtige Mo/Si-Beschichtung, die bei 13,5 nm eine Reflexion von mehr als 60% bietet. Sie sind für einen Einfallswinkel von 5° ausgelegt und dienen zur Fokussierung von unpolarisierten EUV-Laserquellen. Eine Oberflächenrauheit von weniger als 3 Å effektiv sorgt für minimale Streuung. Dies ist für EUV-Wellenlängen von Bedeutung, da die Streuung dort größer ist, als bei längeren Wellenlängen. TECHSPEC Sphärische EUV-Spiegel haben einen sehr schmalen Reflexionsbereich von ca. 0,5 nm, sodass nur die interessante 13,5-nm-Harmonische in HHG-Anwendungen (High Harmonic Generation) reflektiert wird. [Typische Anwendungen](#) für sphärische EUV-Spiegel sind Bildgebung mittels kohärenter Beugung (Coherent Diffractive Imaging, CDI), EUV-Bildverarbeitung und EUV-Nanomaterialbearbeitung.

Hinweis: Zum Lieferumfang gehören Testdaten für den Probespiegel der jeweiligen Fertigungsläufe.